Patentansprüche

1. Waffensystem (100) mit wenigstens zwei HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3), die jeweils wenigstens ein Strahlführungssystem (2.1, 2.2, 2.3) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens zwei HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3) zumindest eine gemeinsam nutzbare Laserquelle (1) oder Pumpquelle(n) (10) umfassen.

2. Waffensystem (100) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine Laserquelle (1) mit den wenigstens zwei Strahlführungssystemen (2.1, 2.2, 2.3) über wenigstens eine zwischen einem Ausgang der Lasereinheit (1) und einem Eingang der Strahlführungssysteme (2.1, 2.2, 2.3) installierten optischen Schalteinheit (4) zur Schaffung der HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3) verschaltbar ist.

3. Waffensystem (100) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine Pumpquelle (10) über wenigstens eine zwischen einem Ausgang der Pumpeinheit (10) und einem Eingang eines Oszillators (21.1, 21.2, 2s.3) der jeweiligen HEL-Effektors (5.1, 5.2, 5.3) angeordneten optischen Schalteinheit (4) zur Schaffung der HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3) verschaltbar ist.

4. Waffensystem (100) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine Pumpquelle (10) über wenigstens eine zwischen einem Ausgang der Pumpeinheit (10) und einem Eingang eines Verstärkers eines MOPA (21.1, 21.2, 21.3) des jeweiligen HEL-Effektors (5.1, 5.2, 5.3) angeordneten optische Schalteinheit (4) zur Schaffung der HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3) verschaltbar ist.

5. Waffensystem (100) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine Pumpeinheit (10) über wenigstens eine zwischen einem Ausgang der Pumpeinheit (10) und einem Eingang eines Verstärkers (.1, .2, .3) der jeweiligen HEL- Effektors (5.1, 5.2, 5.3) eingebrachte optische Schalteinheit (4) und wenigstens ein Master Oszillator (22) über wenigstens eine zwischen einem Ausgang des Master Oszillators (22) und einem weiteren Eingang des Verstärkers (.1, .2, .3) der jeweiligen HEL-Effektors (5.1, 5.2, 5.3) eingebrachte optische Schalteinheit (14) zur Schaffung der HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3) verschaltbar sind.

6. Waffensystem (100) nach einem Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wenigstens eine optische Schalteinheit (4, 14) ein optischer Schalter oder eine optische Schaltweiche ist.

7. Waffensystem (100) nach einem der Ansprüche 2 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass durch die optische Schalteinheit (4, 14) die Strahlleistung der Laser- bzw. Pumpquelle (1, 10) der HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3) eingestellt und/oder variiert werden kann.

8. Objekt mit einem Waffensystem (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Laserquelle (1), die Pumpquelle(n) (10) und ggf. der Master Oszillator (22) zentral und/oder dezentral bezogen auf die Strahlführungen (2.1, 2.2, 2.3) auf bzw. im Objekt anordbar sind.

9. Objekt nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest die Strahlführungssysteme (2.1, 2.2, 2.3) der HEL-Effektoren (5.1, 5.2, 5.3) auf Plattformen (7, 8, 9) lafettierbar sind.

10. Objekt nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Objekte stationärer Art, wie Häuser, Bunker, Container, etc., oder beweglicher Art, wie Fahrzeuge zu Land, Luft und See, Container, etc., sein können.